This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-247763

(43)公開日 平成11年(1999)9月14日

(51)Int.CL ^a	識別配号	FΙ	
F04B 43/0	96	F04B 43	3/06 A
43/0	14	43	3/04 B
G01N 35/1	0	G 0 1 N 35/06 A	
		審查請求	未請求 請求項の数7 OL (全 7 頁)
(21)出顧番号	特顧平10-51760	(71)出顧人	000005108 株式会社日立製作所
(22) 出顧日	平成10年(1998) 3月4日		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		(72)発明者	
		I	茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内
		(72)発明者	三宅 亮
			茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内
			寺山 孝男 茨城県ひたちなか市市毛882番地 株式会
			社日立製作所計測器事業部内
		(74)代理人	弁理士 小川 勝男
			最終頁に続く

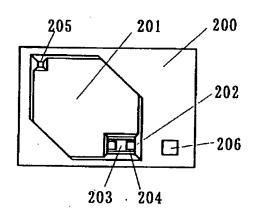
(54) 【発明の名称】 送液装置および自動分析装置

(57)【要約】

【課題】従来のマイクロポンプでは、送液室内に気泡が 残り、気泡の影響で所定量の液体を供給するために圧力 変動を発生し、高周波駆動ができないという課題があっ た。

【解決手段】本発明では、入口弁と出口弁を送液室の一方の面の略対角の周辺位置に一体に形成することによって、気泡抜き操作時に入口から出口へと気泡がスムーズに流れるようにし、送液の際に圧力変動が問題となる送液室内に気泡が残らないようにする。また、弁の着座部に数μm以上の高さの突起を設けることで、両持ち梁を歪ませて弁に与圧を与えて締切り性を高め、かつ、弁として変位方向に対して表面積の小さな両持ち梁構造とした。

図 2



【特許請求の範囲】

【請求項1】外から流体が入る入口と、前記入口側に設けられ流体が流入するときは抵抗が小さく出るときは抵抗が大きい弁と、流体が外に流出する出口と、前記出口側に設けられ流体が出るときは抵抗が小さく入るときは抵抗が大きい弁とを備えた送液室と、前記送液室を構成する一つの面が変形可能なダイアフラムで構成され、前記ダイアフラムを送液室の容積が増加する方向に変形させるととで前記入口から送液室に流体を導入し、前記ダイアフラムを送液室の容積が減少する方向に変形させる10とで前記出口から送液室内の流体を吐出する送液装置において、

1

前記送液室の前記ダイアフラムと対向する側の面を略2 分する線で区分した一方側の周辺部に前記入口を、他方 側の周辺部に前記出口を設けたことを特徴とする送液装 置。

【請求項2】外から流体が入る入口と、前記入口側に設けられ流体が流入するときは抵抗が小さく出るときは抵抗が大きい弁と、流体が外に流出する出口と、前記出口側に設けられ流体が出るときは抵抗が小さく入るときは 20 抵抗が大きい弁とを備えた送液室と、前記送液室を構成する一つの面が変形可能なダイアフラムで構成され、前記ダイアフラムを送液室の容積が増加する方向に変形させることで前記入口から送液室に流体を導入し、前記ダイアフラムを送液室の容積が減少する方向に変形させることで前記出口から送液室内の流体を吐出する送液装置において、

前記送液室の平面形状が曲率を有し、前記送液室の前記 ダイアフラムと対向する側の面を略2分する線で区分し た一方側の辺部に前記入口を、他方側に前記出口を設け 30 たことを特徴とする送液装置。

【請求項3】外から流体が入る入口と、前記入口側に設けられ流体が流入するときは抵抗が小さく出るときは抵抗が大きい弁と、流体が外に流出する出口と、前記出口側に設けられ流体が出るときは抵抗が小さく入るときは抵抗が大きい弁とを備えた送液室と、前記送液室を構成する一つの面が変形可能なダイアフラムで構成され、前記ダイアフラムを送液室の容積が増加する方向に変形させることで前記入口から送液室に流体を導入し、前記ダイアフラムを送液室の容積が減少する方向に変形させるとで前記出口から送液室内の流体を吐出する送液装置において、

前記送液室の平面形状が多角形であり、前記送液室の前 記ダイアフラムと対向する側の面を略2分する線で区分 した一方側の辺部に前記入口を、他方側に前記出口を設 けたことを特徴とする送液装置。

【請求項4】請求項3記載の送液装置において、前記入口及び出口を角部に設けたことを特徴とする送液装置。 前記

【請求項5】請求項1から4記載のいずれかの送液装置 50

において.

前記入口または出口に設けた弁は両持ち架構造とし、前 記弁の中央の着座部を弁両端の支持部よりも突出させ、 前記両持ち架を弾性変形させ、弾性力により弁着座部を 前記入口または出口に押し付けているととを特徴とする 送液装置。

【請求項6】複数の反応容器と複数の試薬容器を保持し、前記試薬容器の各々に送液装置を設け、所定の位置でサンプルおよび試薬が供給される反応容器ホルダと、前記サンプルの物性を計測する計測手段とを備えた自動分析装置において、

前記送液装置を前記試薬容器の下部に設け、前記送液装置は外から流体が入るときは抵抗が小さく出るときは抵抗が小さく入るときは抵抗が大きい出口側弁と備えた送液室を有し、前記送液室を構成する少なくとも一つの面が変形可能なダイアフラムで構成され、前記ダイアフラムと対向する側の面を2分する線の一方側周辺部に前記入口側弁を、他方側に出口側弁を設け、前記ダイアフラムを前記送液室の容積が増加する方向に変形させることで入口側弁より流体を導入し、送液室の容積が減少する方向に変形させることで出口側弁を介して流体を吐出させる構成としたことを特徴とする自動分析装置。

【請求項7】複数の反応容器と複数の試薬容器を保持し、前記試薬容器の各々に送液装置を設け、所定の位置でサンブルおよび試薬が供給される反応容器ホルダと、前記サンブルの物性を計測する計測手段とを備えた自動分析装置において、

前記送液装置を前記試業容器下部に設け、前記送液装置は、外から流体が入るときは抵抗が小さく出るときは抵抗が大きい入口側弁と、外に流体が出るときは抵抗が小さく入るときは抵抗が大きい出口側弁とを備えた送液室と、前記送液室を構成する少なくとも一つの面が変形可能なダイアフラムで構成され、前記ダイアフラムを送液室の容積が増加する方向に変形させて入口側弁より流体を導入し、前記送液室の容積が減少する方向に変形させて出口側弁から流体を吐出するように構成し、前記各々の弁が両持ち架構造で形成され、前記弁の中央の着座部を弁両端の支持部よりも突出させ、前記両持ち架を弾性変形させ、その弾性力により弁の着座部が入口または出口に押し付けられていることを特徴とする自動分析装

【発明の詳細な説明】

[0001]

40

置。

【発明の属する技術分野】本発明は送液装置に係り、特に毎秒数 μ Lから数百 μ Lの送液を行うマイクロポンプを用いた送液装置およびそれを用いた自動分析装置に関する。

[00021

【従来の技術】従来のマイクロポンプとしては、特表平

3

4-502796号公報に記載されたものがある。との マイクロポンプは入口弁室、送液室、出口弁室、の3つ の部屋からなり、送液室内へ流体が入っていく入口の位 置を送液室中央より周辺部にずらすことで送液室内の入 口のある反対側に気泡を集め、その部分に出口となるオ リフィスを設けてそこから気泡を抜き取るというもの で、これにより送液室内の気泡を効率的に除去する。ま た、弁の締切り性を上げるためにダイアフラム型弁の着 座部に薄膜を成膜し、それにより弁と弁ポートとの密着 性を上げている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記ポンプ構 造では、送液室内の気泡は除去できても、送液室の出口 オリフィスから先の出口弁室内の気泡を除去することが できず、ポンプの吐出特性に対する気泡の影響を完全に なくすととは難しい。また、三つの部屋から成るため、 平面サイズが大きくなり、低コスト化のネックとなる。 弁の締切り性はダイアフラム型弁に与圧を与えることで 高くしているが、ダイアフラムに加わる液体の抵抗によ り高周波での駆動は難しく、吐出流量を毎秒数百 μ L ま 20 で上げていくことは困難である。

【0004】本発明の目的は、ポンプの吐出特性に対す る気泡の影響を取り除き、かつ簡単構成で高周波駆動の 可能なマイクロポンプを実現した。また、それを試薬供 給部に用いることによって、髙精度の試薬供給の可能な 自動分析装置を実現することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明では、入口弁と出 口弁を送液室と一体にし、かつ、弁の位置を送液室の周 辺部に偏在させることで入口から出口へと気泡の流れを スムーズにし、送液の際に圧力変動が問題となる送液室 内に気泡が残らないようにする。また、弁の着座部に数 μm以上の高さの突起を設けることで両持ち架を歪ませ て弁に与圧を与えて締切り性を高め、かつ、弁として変 位方向に対して表面積の小さな両持ち架構造を用いると とで周辺流体の抵抗を低減して周波数応答性を改善す る。

[0006]

【発明の実施の形態】図1に本発明第1の実施例の送液 装置の断面図を、図2に本発明第1の実施例の送液装置 40 の送液室の平面図を示す。

【0007】送液装置は、吐出ノズル基板110上に設 けられた出口弁基板120と、前記出口弁基板上に設け られた送液室基板130と、送液室基板130上に設け られたダイアフラム基板140の4枚の基板から構成さ れている。吐出ノズル基板110には吐出ノズル111 が形成されている。出口弁基板120には出口弁121 と入口流路122、入口ポート123が形成されてい る。送液室基板130には送液室131と入口弁13

る。ダイアフラム基板140にはダイアフラム141と 剛体部142、入口流路143と入口144、が各々形 成されている。

【0008】この送液装置の送液手順は以下の通りであ

【0009】まず、送液装置の送液室131内の気体を 液体に置き換えるため、送液装置の入口144には、導 入する液体を送り込む液体導入装置(図示せず)を接続 する。液体導入装置から入口144に液体が加圧送液さ 10 れると、液体流路143、134、122を通って入口 弁132に加圧された液体が到達し、その加圧力により 入口弁132が開いて入口より液体が送液室131に流 れ込む。との際、ダイアフラム141の下の平板状の流 路に表面張力で液体が自然に流れ込む場合には、その平 板状の流路を流れる流量よりも大きな流量の液体を、液 体導入装置から送液室131内に送り込むことが必要で ある。

【0010】入口144から液体が流入すると、入口部 にある気体は液体により平板流路へと押し流され入口部 が液体に満たされる。また、ダイアフラム141下の平 板状の流路に、液体が自分自身では流れ込んで行かない 場合には、液体導入装置からの送液の速度は任意で良 く、液体導入装置より押し込まれる液体によって入口側 から気体が押し流されて行き、出口側に追い込まれ全て の気体が送液室131から押し出される。送液室内が液 体で満たされたら入口144に接続された液体導入装置 を吐出流体の入った容器と交換して接続し、送液準備が 完了する。

【0011】なお、送液室131内を気体から液体に置 き換える方法として、吐出ノズル111に真空ポンプを 接続し、入口144に吐出流体(液体)の入った容器を 接続しても前記と同様に行える。真空装置により吐出ノ ズル111から送液装置内の気体が吸い取られると、出 口弁121の背圧が送液室131内圧力より低くなって 出口弁が開き、送液室131内の気体が吸い出される。 これにより、送液室131内の圧力が入口ポート123 の圧力よりも低くなり、入口弁132が開き、入口流路 122、134、143内の気体が送液室131内に吸 い込まれていく。

【0012】との結果、吐出流体が入った容器から吐出 流体が入口流路122、134、143内に流入し、入 口弁132まで到達する。 真空ポンプで引き続けるとと により、気体と同様に液体も入口弁132を開いて入口 より液体が送液室131に流れ込む。この際、ダイアフ ラム141の下の平板状の流路に表面張力で液体が自然 に流れ込む場合には、その平板状の流路を流れる流量よ りも大きな流量の液体を真空ポンプにより吸引し、送液 室131内を液体が満たすように吸い込むことが必要で ある。それにより、入口部にある気体は液体より平板流 2、出口ボート133と入口流路134が形成されてい 50 路へと押し流され入口部が液体で満たされる。

【0013】また、ダイアフラム141下の平板状の流 路に流体が自分自身では流れ込んで行かない場合には、 真空ポンプからの吸引力は任意で良く、真空ポンプによ り吸引される液体によって入口から気体が押し流されて 行き、出口に追い込まれ全ての気体が送液室131から 押し出される。

【0014】送液室内が液体で満たされたら吐出ノズル 111から真空ポンプと分離し、送液準備が完了する。 次に送液動作について説明する。

【0015】送液は、まず、後述するようなアクチュエ ータによりダイアフラム141を送液室131側に押し 込むと、送液室131の容積が減少し、その減少した容 積分の液体が出口弁121を押し開けて出口ボート13 3から送液室131外へと流れ出し、吐出ノズル111 より吐出される。次に、アクチュエータを駆動してダイ アフラム141を送液室131の容積が大きくなる方向 に変形させると、増加した容積分だけの流体が入口弁1 32を押し開けて入口ポート123から送液室131内 に流入する。との動作を繰り返すことで送液が行われ

【0016】本実施例の特徴は3つある。第一に、送液 室201と入口弁202、203、204、吐出ポート 205が同じ送液室基板200内に加工されている点で ある(図2)。これにより、入口から吐出ノズルまでの 容積 (デッドボリューム) が小さくなり、一度に動かす 流体量が少なくなるので流体の慣性力を最小にでき、周 波数応答性が良くなる。また、送液室内が一体成形でき るために気泡の付着をまねく段差構造等をなくすことが 可能となり、周波数応答性を阻害する気泡の残留を防止 できる。

【0017】第二の特徴は、送液室201の形状を流路 型にし、流路の両端を出入口202、205にしている 点である。とれにより、入口202から入ってきた液体 が流路を流れるときに気体を出口204側に自然に押し 流すことが可能となり気泡の除去を容易にしている。

【0018】第三の特徴は、図3に示すように、弁の着 座部301の突起をシリコン加工で弁と一体成形すると とで高段差で耐久性のある突起を成形している点であ る。これにより、弁着座部301の高さを任意に設定す て弁の締切り性を向上することが可能となり、送液装置 の周波数特性を改善できる。また、弁着座部301を弁 の変位方向に対して表面積の小さな梁302で支えると とで弁の変位時の周辺流体の抵抗を低減して弁の周波数 特性を改善できる。

【0019】なお、送液の際のダイアフラムの駆動波形 は、図4に示すように正弦波のような常にダイアフラム が変形し続けるようなものではなく、ダイアフラムの最 大変形時にその変形状態をしばらく維持するような駆動 ている間に入口弁、出口弁ともに完全に閉じることがで き、弁の締切り性を向上することができる。

【0020】送液装置を動かす際のダイアフラムの駆動 手段の一例を図5に示す。これは、ダイアフラムの駆動 に積層圧電素子502を用いたもので、ダイアフラム1 41と積層圧電索子502の固定は、ケーシング503 により行われる。ポンプ501とケーシング503は固 着され、また、ケーシング503と積層圧電素子50 2、積層圧電素子502とポンプ501の剛体部142 は各々固着されている。

【0021】なお、積層圧電素子には電極が設けられ 電極間に高周波の電圧を印加することでポンプが駆動さ れる。なおこの他にも、ダイアフラム間に電極を設け直 接ダイアフラムを駆動する方法等もある。

【0022】図6に本発明の送液装置を自動分析装置に 適用する際の実装状態の一例を示す。図6 (a)は自動 分析装置の全体構成を、図6(b)には試薬供給部の詳 細図を、図6(c)に試薬送液装置を設けた試薬容器を 示す。

20 【0023】自動分析装置では、血清サンブルと試薬と を反応させて健康状態を計測するが、血清サンプルと反 応させる試薬の計量吐出に本発明の送液装置を適用した 例を示した。

【0024】図6(a)に示すように、自動分析装置6 00は次のように構成されている。

【0025】まず、測定すべきサンブルが収納されたサ ンブル容器を少なくとも 1 つ以上収納できるサンプル容 器ホルダー611と、サンプル容器ホルダー611に収 納されたサンブル容器をサンブル吸引位置まで移送する 30 ためのサンブル容器ホルダー回転駆動機構612を備え ている。更に、サンブルと少なくとも1種類以上の試薬 を入れて反応させるための反応容器を少なくとも1つ以 上収納することのできる反応容器ホルダー623と、反 応容器ホルダー623に収納された反応容器をサンブル 吐出位置、第1試薬吐出位置及び第2試薬吐出位置まで 移送するための反応容器ホルダー回転駆動機構622を 備えている。

【0026】また、サンブル吸引位置まで移送されたサ ンプル容器内にノズルを挿入してサンブル容器からサン るととで弁とポートとの密着性を制御して、用途に合せ 40 ブルを吸引してサンブル吐出位置の反応容器内に所要量 分注するサンブルピペッタ628と、サンブルピペッタ 628を洗浄するサンブルビベッタ洗浄機構(図示せ ず)とを有している。また、反応容器ホルダー623に は反応容器内のサンブル及び試薬を一定温度に保つため の恒温槽と、測定項目に対応する第1試薬を収納した第 1試薬容器630と、第1試薬容器630を少なくとも 1つ以上収納することのできる第1試薬容器ホルダー6 40と、第1試薬容器ホルダー640に収納された第1 試薬容器830を第1試薬吐出位置まで移送する第1試 彼形がよい。これにより、ダイアフラムの変形が止まっ 50 薬容器ホルダー回転駆動機構 6 3 2 とを備えている。

7

【0027】更に、第1試薬吐出位置まで移送された第 1試薬容器630から第1試薬吐出位置のサンブルの入っている反応容器に第1試薬を所要量分注する第1試薬 ポンプユニットと、本図では第1試薬容器ホルダーと同 一構成の第2試薬を収納した第2試薬ホルダー640設 けて有る。

【0028】なお、図示してはいないが反応容器ホルダーの周囲には、反応容器に入れたサンブルと少なくとも 1種類以上の試薬を混ぜ合わせる撹拌機構を備えてい

る。更に、反応容器に入れたサンブルと少なくとも1種類以上の試薬の反応による吸光度の変化を測定する光学分光計測部と、光学分光計測が終了した反応容器を洗浄する反応容器洗浄機構等が配置されている。

【0029】本例では、試薬の入っている試薬容器63 0の直接送液装置650を取り付けて、試薬容器から直 接試薬と吐出するように用いる。このように、試薬容器 630に前述の実施例で説明した送液装置650を設け ることにより、従来別に設けていた試薬供給装置を設け る必要がなくなり、装置の小型化が図れると共に、試薬 供給装置による異なる試薬の混入が防止でき、かつ気泡 20 の影響による送液不良を防止でき、精度区試薬を供給で き、高精度の分析が可能になる。

【0030】図7に本発明の第2の実施例の送液室平面図を示す。送液装置は、図1の構成と同一部位は同一部品番号を付してある。図1と異なる点は送液室の周辺形状を所定の曲率を有する曲線で構成し点にある。その他は図1と同じで、動作も図1で説明した動作と同じであるため、ここでの説明は省略する。

【0031】次に本実施例の特徴を説明する。

【0032】第一に、送液室201と入口弁202、203、204、吐出ボート205が同じ送液室基板200内に加工されている点である。これにより、入口から吐出ノズルまでの容積(デッドボリューム)が小さくなり、一度に動かす流体量が少なくなるので流体の慣性力を最小にでき、周波数応答性が良くなる。また、送液室内が一体成形できる。また、気泡の付着をまねく段差や角部等をなくすことが可能となり、周波数応答性を阻害する気泡の残留を防止できる。

【0033】第二の特徴は、送被室201の形状を流線 03型にし、流路の両端を出入口202、205にしている 40 置。点である。これにより、入口202から入ってきた液体

が流線型に沿って流れるときに気体を出口204側に自 然に押し流すことが可能となり気泡の除去を容易にして いる。

【0034】なお、弁の着座部等の構成は第1の実施例 と同じで同じ効果が得られる。

【0035】さらに、本実施例を図6の自動分析装置に 適用することのできることは言うまでもない。 【0036】

【発明の効果】以上のように、本発明の送液装置の構成とすることにより、送液室内に気泡の残留をなくすことができ、これによってダイアフラムを高周波駆動することができ、低消費電力で高精度の送液を実現できる。

【0037】また、本送液装置を自動分装置の試薬供給容器に設け試薬供給を行なうことにより、従来別に設けて回転駆動されていた試薬供給装置が不要となり、装置の小型化を図れる共に、反応容器に精度良い量の試薬を供給でき、それにより精度の高い分析が実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の断面図。

【図2】本発明の第1の実施例の送液室基板平面図。

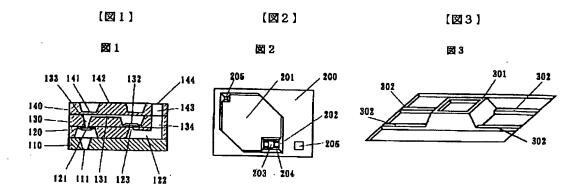
【図3】本発明の弁構造。

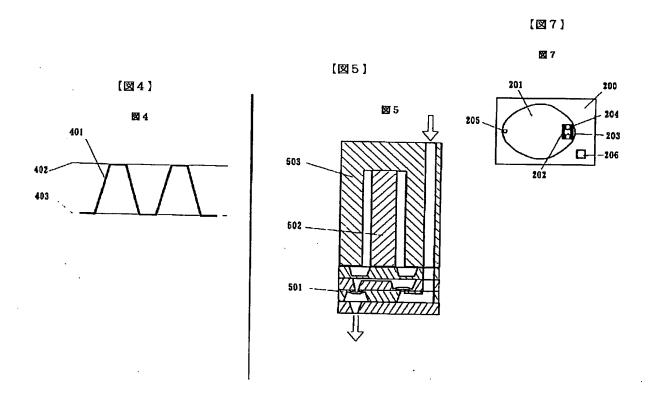
【図4】本発明のダイアフラム駆動波形の一例。

【図5】本発明の実装構造例。

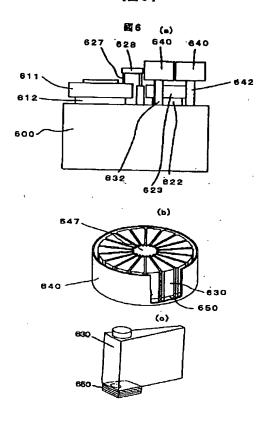
【図6】本発明の送液装置の自動分析装置への適用例。

【図7】本発明の第2の実施例の送液室基板平面図。 【符号の説明】





【図6】



フロントページの続き

(72)発明者 三巻 弘

茨城県ひたちなか市市毛882番地 株式会 社日立製作所計測器事業部内 (72)発明者 盛岡 友成

茨城県ひたちなか市市毛882番地 株式会 社日立製作所計測器事業部内